

走査型電子顕微鏡セミナー

主催：（公財）福島県産業振興センター 共催：福島県ハイテクプラザ

走査型電子顕微鏡は、金属、半導体、セラミックスなどの様々な分野で活用され、三次元的な画像により表面観察ができる用途の広い装置です。分析用の多様な付属装置・機器との接続によって、研究開発や品質検査の現場で活躍しています。

本セミナーでは、走査型電子顕微鏡の基礎的な仕組み、観察での注意点、試料前処理について解説します。また、ハイテクプラザ保有装置の見学、活用方法をご紹介します。

- 内 容
- ・走査型電子顕微鏡の基礎
 - ・走査型電子顕微鏡で観察のための試料前処理の基礎
 - ・ハイテクプラザ内の見学
- 走査型電子顕微鏡装置と前処理装置の紹介

- 日 時 令和7年7月18日（金）13時30分～16時30分
- 場 所 福島県ハイテクプラザ（郡山市待池台 1-12）1 F 研修室
- 受講料 無料 ○定 員 20名
- 講師 （株）日立ハイテクフィールドイング 西村雅子氏、柏原慎一氏
- 締め切り 令和7年7月15日（火）
- 申込・問合せ （公財）福島県産業振興センター技術支援部（テクノ・コム）竹内
〒963-0215 郡山市待池台 1-12（福島県ハイテクプラザ内）
[Tel 024-959-1929](tel:024-959-1929) Fax 024-959-1889
E-mail seminar@f-open.or.jp

下記申込書にご記入の上、E-mail 又は FAX にてお申し込みください。

「走査型電子顕微鏡セミナー」申込書

企業名（業種）	()	
所在地	(〒)	
電話/FAX	電話	FAX
受講者名（所属）	()	
受講者名（所属）	()	
受講者名（所属）	()	

事務連絡担当者名 _____ 所属 _____

e-mail _____

* 申し込み事項には、すべてご記入ください。

* ご記入いただいた情報は、当センター実施事業に使用させていただく場合がありますのでご了承ください。